## AIR ION GENERATOR

Patent number:

JP6304238

**Publication date:** 

1994-11-01

Inventor:

HATANAKA TAKESHI

**Applicant:** 

HI TECH LAB INC

Classification:

- international:

A61L9/22; H01T23/00

- european:

Application number:

JP19930126447 19930419

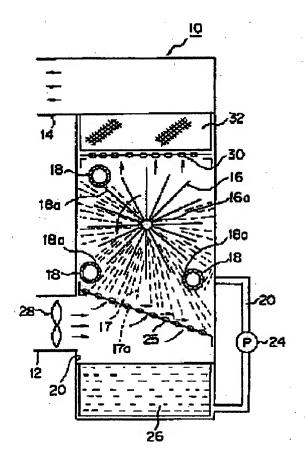
Priority number(s):

JP19930126447 19930419

Report a data error here

## Abstract of JP6304238

PURPOSE:To efficiently generate a large quantity of air ions through cleaning air by forming the superfine water droplets through the contact of the fine water droplets with a screen means and continuously generating a large quantity of air ions through the contact of air with the superfine water droplets. CONSTITUTION:An air ion generator has a suction port 12 and a discharge port 14 on an air ion generation tower 10, and a fan 28 for the passing of air is installed between the suction port 12 and the discharge port 14, and a high speed rotary brush 16 is arranged between the suction port 12 and the discharge port, and a superfine water droplet forming screen 25 is arranged between the air suction port 12 and the high speed rotary brush, and a water feeding pipe 18 for feeding water to the high speed rotary brush 16 is arranged. When water is supplied to the high speed rotary brush 16 from the water feeding pipe 18, fine water droplets 17 are splashed in the radial form by the centrifugal force of the high speed rotary brush 16, and allowed to collide with the inner wall of the air ion generation tower 10, and superfine water droplets 17 are formed, and further the water droplets are allowed to collide with the screen means to generate the superfine water droplets, and a large quantity of air ions are continuously generated through the contact with air.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

## 特開平6-304238

(43)公開日 平成6年(1994)11月1日

(51) IntCL<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

A 6 1 L 9/22

7344-4C

H01T 23/00

7509-5G

審査請求 未請求 請求項の数4 書面 (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平5-126447

(71)出願人 592071451

株式会社ハイテク研究所

(22)出願日

平成5年(1993)4月19日

東京都港区赤坂3-2-6 赤坂中央ビル

(72)発明者 畑中 武史

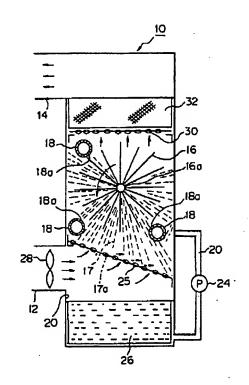
東京都小金井市緑町1-4-14

## (54) 【発明の名称】 空気イオン発生装置

## (57)【要約】

【目的】 空気をスクリーン手段を通過させる間にスクリーン手段の線条部に衝突してできた超微細水滴に接触させて1次清浄をしながら空気イオンを発生させ、さらに空気を高速回転ブラシにより形成された微細水滴が内壁に衝突して分裂した超微細水滴に接触させて2次清浄しながら空気イオンを発生させることにより圧力損失が少なくて効率の高い空気イオン発生装置を提供することを目的とする。

【構成】 吸気口(12)と排気口(14)との間に超微細水滴スクリーン手段(25)と高速回転プラシ(16)とを順次配置し、空気をスクリーン手段と高速回転プラシとを通過させることにより大量の空気イオンを効率的に発生させることができる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 空気イオン発生塔に吸気口と排気口とを 設け、吸気口と排気口との間に空気を通過させる送風手 段を備え、吸気口と排気口との間に高速回転プラシを配 置し、吸気口と高速回転プラシとの間に超微細水滴形成 スクリーン手段を配置し、高速回転プラシに給水する給 水手段を配置し、給水手段から高速回転プラシに給水す ることにより高速回転プラシの遠心力により微細水滴を 放射状に飛ばして空気イオン発生塔の内壁に衝突させて 超微細水滴を形成するとともに、微細水滴をさらにスク リーン手段に衝突させて超微細水滴を形成し、空気を超 微細水滴に接触させて大量の空気イオンを連続的に発生 させることを特徴とする空気イオン発生装置。

【請求項2】 請求項1において、さらに排気口と高速 回転プラシとの間に除滴手段を備えた空気イオン発生装

【請求項3】 請求項1において、スクリーン手段は線 条部と孔部とを備えた金属部材からなる空気イオン発生 装置。

【請求項4】 空気イオン発生塔に吸気口と排気口とを 20 設け、吸気口と排気口との間に空気を通過させる送風手 段を備え、吸気口と排気口との間に高速回転プラシを配 置し、吸気口と高速回転プラシとの間に超微細水滴形成 スクリーン手段を配置し、高速回転プラシに銀イオンを 含有した水を給水する銀イオン水供給手段を配置し、銀 イオン水供給手段から高速回転プラシに銀イオン水を給 水することにより高速回転プラシの遠心力により微細水 商を放射状に飛ばして空気イオン発生塔の内壁に衝突さ せて銀イオン水の超微細水滴を形成し、微細水滴をさら にスクリーン手段に衝突させて銀イオン水の超微細水滴 30 を形成し、空気中の微粒子を超微細水滴に接触させて殺 菌しながら大量の空気イオンを連続的に発生させること を特徴とする空気イオン発生装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は空気イオン発生装置に関 し、さらに詳しくは、工業用、医療用、環境衛生用の空 気イオン発生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】空気イオン発生装置として正極と負極と 40 の間で高圧放電するタイプのものが提案されているが、 この装置は有毒なオゾンを発生するだけでなく、電極に チリ・ホコリが付着し易いため、効率が悪く、空気は汚 れる欠点がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上配欠点を解決するた めに、特開昭61-61634号の発明では通気孔型セ ラミック多孔体を水でしめらせて水膜をつくる工程と、 該水膜を微小水滴に分裂する工程とが提案されているが に大量の空気イオンを発生させることができないという 欠点がある。

【0004】従来から海浜や滝のあるところでは、水し ぶきによる、いわゆる、レナード効果によって空気イオ ン、特に人体に有益である負イオンの発生量が多く、健 康に良いと言われている。この発明は、イオン化に使用 する空気を清浄しながら、水しぶきに相当する超微細水 滴を簡単に人工的に起こして大量の空気イオンを連続的 に発生させようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、この発明は、空気イオン発生塔に吸気口と排気口と を形成し、吸気口と排気口の間の流路に高速回転プラシ を配設して回転プラシと吸気口との間に超微細水滴形成 スクリーンを配置し、高速回転プラシに給水手段により 給水することにより、高速回転プラシの遠心力により微 細水滴を形成し、吸気口からの空気を高速回転プラシの 下側に設置した超微細水滴形成スクリーンを通過させ て、スクリーンに衝突して分裂した超微細水滴に空気を 接触させて大量の負空気イオンを連続的に発生させ、次 に高速回転プラシにより形成された微細水滴を空気イオ ン発生塔の内壁に衝突させてさらに細かく分裂して飛散 させてできた超微細水滴に接触させることにより負空気 イオンをさらに大量に連続的に発生させるものである。

[0006]

【作用】上記構成に基づき、吸気口と排気口との間で回 転プラシの吸気口側に超微水滴形成スクリーン手段を配 置して回転プラシを高速回転させながら、回転プラシに 給水してやると、水滴が回転プラシの遠心力により微細 化される。この微細水滴はスクリーンに衝突して超微細 水滴となる。吸入空気は吸気口からスクリーン手段を通 過する間に、スクリーン手段に衝突して分裂した超微細 水滴に接触して負空気イオンが発生するとともに清浄さ れる。さらに空気は高速回転プラシにより形成された微 細水滴が空気イオン発生塔に衝突して分裂した超微細水 滴に接触することによってさらに大量の負空気イオンが 発生する。

[0007]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。空気イオン発生塔10に吸気口12と排気口14 とを形成し、その中間部に高速回転プラシ16を配設す る。高速回転プラシ16は回転軸16aに金属またはプ ラスチック製の多量の密集したプラシを植毛したもので ある。回転プラシ16の外周に複数の給水パイプ18か らなる給水手段を近接させてノズル18 aから回転プラ シ16の回転軸16aに向かって給水される。給水パイ プ18はメインパイプ20を介して受水槽22に接続さ れていて、ポンプ24により給水される。吸気口12と 回転プラシ16の中間にはアートメタルまたはエキスパ 装置が複雑であるだけでなく、効率が悪いため、連続的 50 ンドメタルその他の特殊スクリーンからなる超微細水滴 3

形成スクリーン手段25が配置されている。受水槽22 内には内部に殺菌用の砂またはガラス等の銀イオンコーティング材をつめたパック26を濾剤として浸積されている。銀イオンは受水槽22の水の中に僅かに溶出して、受水槽22、空気イオン発生塔10の内壁、スクリーン手段25、および回転ブラシ16におけるバクテリア、菌類、薬類等の除去をするとともに、超微細水滴中の銀イオンが空気中のパクテリア、細菌類を効果的に殺菌して、空気イオン発生用の水と空気をクリーンにする効果がある。吸気口12には吸気ファン28が配置されている。高速ブラシ16の上部には空気中の水滴を除去するためのエリミネータ30または、デミスター32からなる除滴手段が配置されている。

【0008】上記構成において、回転プラシ16がモー 夕等の駆動手段 (図示せず) で高速回転されている時に 給水孔18 aから回転軸16 aの方向に給水すると、水 滴は回転プラシ16の遠心力により微細水滴状となって 放射方向に飛び散る。吸気口12からファン28によっ て供給された空気は、線条部25の隙間を通過する間に 回転プラシ16の遠心力の作用により形成された微細水 滴に衝突して負空気イオンが発生し、さらに、線条部2 5に衝突して分裂した超微細水滴に接触して負空気イオ ンが発生する。つぎに、空気は高速回転プラシの遠心力 によって形成された微細水滴が空気イオン発生塔の内壁 に衝突してできた超微細水滴に接触して負空気イオンが 発生する。このように、スクリーン手段に衝突して分裂 した超微細水滴と空気イオン発生塔の内壁に衝突して分 裂した超微細水滴との2段階で負空気イオンが大量に効 率的に発生する。しかも、装置の構造が極めてコンパク

トで設置スペースが最小となり、電力及び水量のランニングコストも著しく抑えられる。

【0009】図2、3はスタップスクリーンからなるスクリーン手段25の1例を示すもので、25aはベースメタル、25bはベースメタル25aの片側に形成されたスタップからな第1線条部、25cはベースメタル25aの反対側に形成されたスタップからなる第2線条部を示す。空気の一部はベースメタル25aに衝突するとともに、他の一部はベースメタルとスタップ25b、25cの隙間を通過する。このとき空気は微細水滴17およびスクリーン25に衝突して分裂した超微細水滴に衝突して効率的に負空気イオンが発生する。

#### [0010]

【発明の効果】この発明によれば、密集したブラシを有する高速ブラシとスクリーン手段の組合せにより空気を清浄しながら大量の負空気イオンを効率的に発生することができる。 微細水滴によって微細な塵埃のみでなく、細菌やウイルスまでも除去して環境衛生上望ましい空気イオンを発生することができる。この方法によれば装置構成が単純化されるとともに、ボンブは汎用の給水ポンブの使用が可能となり、水の消費量およびポンブならびに回転ブラシの消費電力を低いレベルに押さえることができるため、装置コストおよびランニングコストの大幅な低減が可能となる。

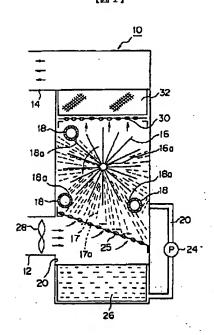
## 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明による望ましい実施例の空気イオン発生装置を示す。

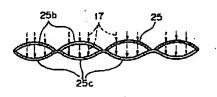
【図2】図2は図1の線状手段の第1側面図を示す。

【図3】図3は図1の線状手段の第2側面図を示す。

図1]



[図2]



【図3】

